

EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' - January 20, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. “The latest introduction to our family of nanoimprint solutions, the EVG7300, combines our SmartNIL full-field imprint technology with lens molding and lens stacking in a state-of-the-art system with the most precise alignment and process parameter control on the market—providing our customers with unprecedented flexibility for their industry research and production needs.” stated Thomas Glinsner, corporate technology director at EV Group. The EVG7300 is a highly flexible platform that offers three different process modes (lens molding, lens stacking and SmartNIL nanoimprint) and support for substrate sizes ranging from 150-mm to 300-mm wafers.



EV 그룹, 다기능 마이크로 및 나노임프린트 솔루션 'EVG®7300' 선봬

총인: 2022.01.20 오전 10:06
수인: 2022.01.20 오전 10:06



이유형 기자
N 2022년



지금 열람 중



by Guide



(사진제공=EVG)

- ▶ 로봇용이 필지마 1000회 로보 1등 당첨번호 6자리 영방 공개...
- ▶ 살펴보는 "슈퍼유산권" 2주만에 -17% 등락상락 폭

EVG의 최신 솔루션인 EVG7300은 나노임프린트 리소그래피(NIL) 렌즈 몰딩 및 렌즈 스택킹(LV 몰딩) 같은 UV 기반의 여러 프로세스를 단일 플랫폼에 결합한 것이 특징이다. 이 산업용 다기능 시스템은 마이크로 및 나노 패터닝을 물론 레이저 정중 등을 포함하는 광범위한 신규 애플리케이션의 정밀 R&D와 생산 공정 모두에 사용될 수 있다.

이러한 애플리케이션의 사례에는 웨이퍼 레벨 광학(WLO) 광학 센서와 프로젝터 차량용 조향 광학 장치(AE) 헤드셋용 웨이브가이드 바이오 의료 장비 메타 렌즈와 메타 표면 광전자 기기 등이 포함된다. 최대 300mm 웨이퍼까지 지원하고 고정밀 얼라인먼트 향상된 프로세스 웨어 우수한 스프레드 성능을 자랑하는 EVG7300은 다양한 자유도와 높은 정밀도로 나노 및 마이크로 광학 부품과 기기를 대량 생산하고자 하는 사용자의 요구를 충족한다.

프랑스 굴린스너 EV 그룹 기술담당 디렉터는 "나노임프린트 기술에 있어서 20년 이상의 경험을 보유한 EV 그룹은 고객의 변화하는 요구를 충족하기 위해 지속적인 기술 혁신을 통해 더 나은 솔루션을 제공하고 있다. 최신 나노임프린트 솔루션인 EVG7300은 EV 그룹의 SmartNIL 풀-필드 임프린트 기술에 렌즈 몰딩과 렌즈 스택킹을 단일 플랫폼에 결합하고 있으며 시장에서 가장 정밀한 얼라인먼트와 고정 파라미터 제어가 특징인 시스템으로서, 고객이 연구개발과 양산 공정에 사용할 수 있게 해주는 유연성을 제공한다"고 말했다.

EVG7300은 독립된 볼륨에서 사용하거나 또는 EVG의 HERCULES® UV-NIL 트랙 솔루션에 하나의 모듈로 통합해 사용할 수 있다. EVG의 HERCULES® UV-NIL 트랙 솔루션은 사용자의 특정 프로세스 요건에 따라서 세팅과 레지스트 코팅 및 베이킹 같은 전처리 공정이나 후처리 공정을 추가할 수 있다. 또한 EVG7300은 업계 선도적인 얼라인먼트 정확도를 제공한다(300nm까지). 또한 EVG7300은 유연성이 매우 뛰어난 플랫폼으로서, 세 가지 공정 모드(렌즈 몰딩, 렌즈 스택킹, SmartNIL 나노임프린트)를 지원하고 150mm부터 300mm까지 이르는 웨이퍼 크기를 지원한다.